(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2010 年 3 月 25 日(25.03.2010)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2010/032703 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/683 (2006.01) *H02N 13/00* (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2009/065992

(22) 国際出願日: 2009 年 9 月 14 日(14.09.2009)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2008-237995 2008 年 9 月 17 日(17.09.2008) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社クリエイティブ　テクノロジー(CREATIVE TECHNOLOGY CORPORATION) [JP/JP]; 〒1020083 東京都千代田区麹町１－８－１４麹町ＹＫビル５Ｆ Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 辰己　良昭 (TATSUMI Yoshiaki) [JP/JP]; 〒2130034 神奈川県川崎市高津区上作延５０７－１、株式会社クリエイティブ　テクノロジー内 Kanagawa (JP).

藤澤　博 (FUJISAWA Hiroshi) [JP/JP]; 〒6308301 奈良県奈良市高畑町５３７－７ Nara (JP).

(74) 代理人: 佐々木　一也, 外 (SASAKI Kazuya et al.); 〒1050003 東京都港区西新橋２丁目１１番５号ＴＫＫ西新橋ビル５階 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

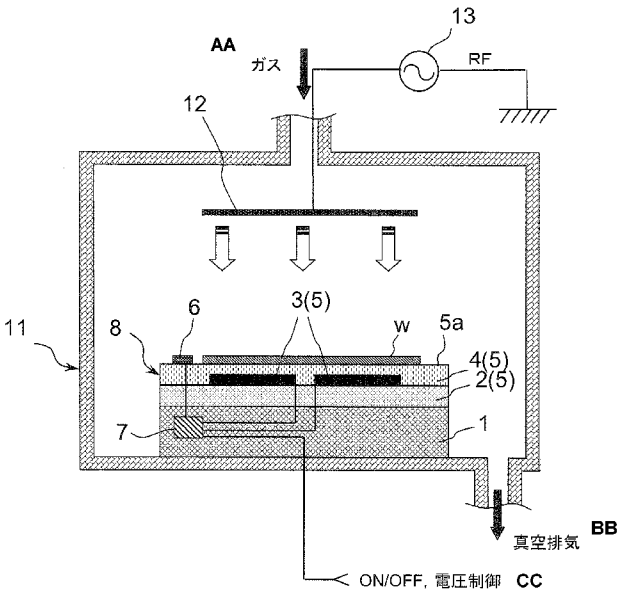
(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL,

[続葉有]

(54) **Title**: ELECTROSTATIC CHUCK

(54) 発明の名称 : 静電チャック

[図1]



AA GAS
BB AIR-RELEASE
CC ON/OFF AND VOLTAGE CONTROL

(57) **Abstract**: Provided is a self power feeding electrostatic chuck (8) which can feed power that an attracting electrode (3) uses, while generating power during a time when substrate is being processed. An electrostatic chuck (8) holds the substrate by attraction in a substrate processing apparatus (11) which processes the substrate by generating optical energy. The electrostatic chuck has an electrode sheet (5) provided with the attracting electrode (3), a metal base (1) having the electrode sheet (5) stacked on the upper surface side, an internal power supply which obtains power to be supplied to the attracting electrode (3), and a voltage increasing circuit (7) which increases the voltage of the power obtained by the internal power supply. The internal power supply is a solar cell (6), and the electrostatic chuck (8) converts optical energy into power while the substrate is being processed, and the substrate is held by attracting the substrate to the electrode sheet (5).

(57) 要約: 吸着電極（３）が使用する電力を基板の処理中に発電しながら供給することができる電力自己補給型の静電チャック（８）を提供する。光エネルギーを発生して基板を処理する基板処理装置（１１）において基板を吸着保持する静電チャック（８）であり、吸着電極（３）を備えた電極シート（５）と、上面側に電極シート（５）を積層させる金属基盤（１）と、吸着電極（３）に供給する電力を得る内部電源と、内部電源で得られた電力の電圧を昇圧する昇圧回路（７）とを有し、内部電源が太陽電池（６）であって、基板の処理中に光エネルギーを電力に変換して、電極シート（５）に基板を吸着保持させることを特徴とする静電チャック（８）である。

WO 2010/032703 A1

NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告（条約第 21 条(3)）